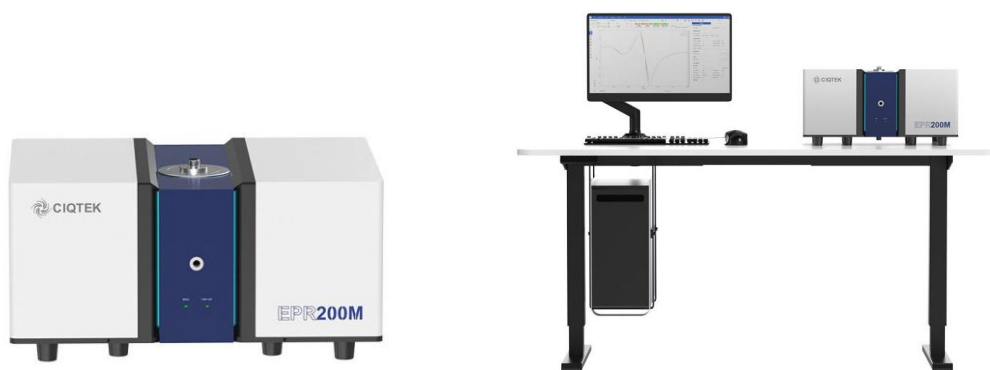


- CIQTEK EPR200M は、ポータブルで使いやすいベンチトップ型電子スピン共鳴(電子常磁性共鳴)分光計です。
- 軽量、コンパクトながら感度と安定性を確保し、メンテナンスコストも少なく、コストパフォーマンスに優れた製品設計になっています。
- ESRテストを必要とするすべての研究者、および産業界のユーザーに、シンプルでフレンドリーな測定環境を提供します。
- 自動化ソフトウェアを搭載、スムーズな実験操作と、高速で正確な定量分析が可能です。

電子スピン共鳴(電子常磁性共鳴)は、不対電子を直接検出して研究できる唯一の分光計技術です。不対電子は、孤立した単一原子、導体、磁性分子、遷移金属イオン、希土類イオン、イオンクラスター、ドープ材料、欠陥物質など、広く分布しています。電子スピン共鳴技術は、物理学、化学、生物学やバイオメディカル、材料、産業、環境科学、食品科学、など非常に広い分野で使用されています。



✓ Features



Reliable & Stable

The highly integrated system ensures the stability and durability of the EPR instrument and enables **low-cost maintenance**.



Ease-to-Use

The intuitive user interface simplifies operation and makes complex experimental setup easy to understand.



Desktop Use

Highly integrated, **lightweight**, and compact.



Easy Tuning

Manual and automatic tuning modes offer both fine control and automated convenience.



Precise Quantitative Analysis

Integrated automated software enables fast and accurate quantitative analysis without reference samples.



Various Accessories

Variable temperature (VT) system, goniometer, in-situ irradiation system, etc.

株式会社エルエイシステムズ
L.A.Systems Incorporated(L.A.S)

〒305-0047 茨城県つくば市千現1-17-1

TEL: 029-896-5270, FAX: 029-896-6501, URL: <https://www.las.jp>, E-mail: support@las.jp

© 2025 L.A. Systems, Inc.

Specifications	Value
Sensitivity	5×10^9 spins / (G*Hz ^{1/2})
Signal-to-noise ratio	$\geq 800:1$
Operating Frequency	9.2 ~ 9.9 GHz
Maximum Modulation Field Amplitude	10 Gauss
Magnetic Field Scanning Range	-1,000 ~ 6,500 Gauss (Supports zero-field scanning)
Maximum Number of Data Points per Scan	256,000 points
Auto Tune	Available

✓ Options:



ESR Liquid Nitrogen VT System
(100K to 600K)



Goniometer



Xenon lamp / UV-enhanced Xenon lamp
320-780 nm wavelength range



Mercury lamp
200-650 nm wavelength range

低温測定や光照射システム、ゴニオメーターなどの各種オプション品も取り揃えております。
お気軽にご相談下さい。

株式会社エルエイシステムズ
L.A.Systems Incorporated(L.A.S)

〒305-0047 茨城県つくば市千現1-17-1

TEL: 029-896-5270, FAX: 029-896-6501, URL: <https://www.las.jp>, E-mail: support@las.jp

© 2025 L.A. Systems, Inc.

<https://www.las.jp>